

迴焊爐(IR Reflow)



設備負責人：林勇志副教授 TEL：07-5252000#6614
Mail：yjlin@nsysu.edu.tw
黃仲平助理教授 TEL：07-5252000#6630
Mail：cp.huang@nsysu.edu.tw

設備管理人：林祐群先生 TEL：07-5252000#6637
Mail：semi_lin@nsysu.edu.tw

儀器資訊：

1. 廠牌型號：惟晶股份有限公司
2. 購置年限：114 年 11 月
3. 放置地點：電資大樓地下室 EC0005(先進封裝實驗室 II)
4. 功能：熔化焊料將電子元件與電路板永久接合
5. 規格：
 - I. 可放入試片尺寸：破片~8 吋晶圓(樣品厚度需小於 15 mm)
 - II. 製程溫度：RT~500°C (溫度均勻性 $\pm 5^{\circ}\text{C}$ 以內)
 - III. 升溫速率： $\leq 5^{\circ}\text{C}/\text{sec}$ ，降溫速率： $\leq 2^{\circ}\text{C}/\text{sec}$
 - IV. 真空能力：2~10 torr
 - V. 製程氣體： N_2 及 CDA
 - VI. 可放入樣品：Si, Glass and AlN substrate with solder ball and paste。其餘未公告之樣品，請向管理人員提出申請且經設備負責人同意後才可使用。

自行操作：

經具有設備自行操作資格人員訓練後且通過考核方取得自行操作資格。
(詳請參閱：本網頁規章表單>設備操作辦法>自行操作資格取得辦法)
通過考核後，可至「國立中山大學半導體聯合實驗室」進行預約及自行操作設備。

委託操作：

請至「國立中山大學半導體聯合實驗室」預約，再於本網頁下載委託操作申請表，將申請表填寫好後送至半導體聯合實驗室由管理人員進行委託代工服務。

收費資訊：

收費標準(單位：元/時)	自行操作	委託操作
學術單位	250	500
業界單位	1000	1500